

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)

PCT

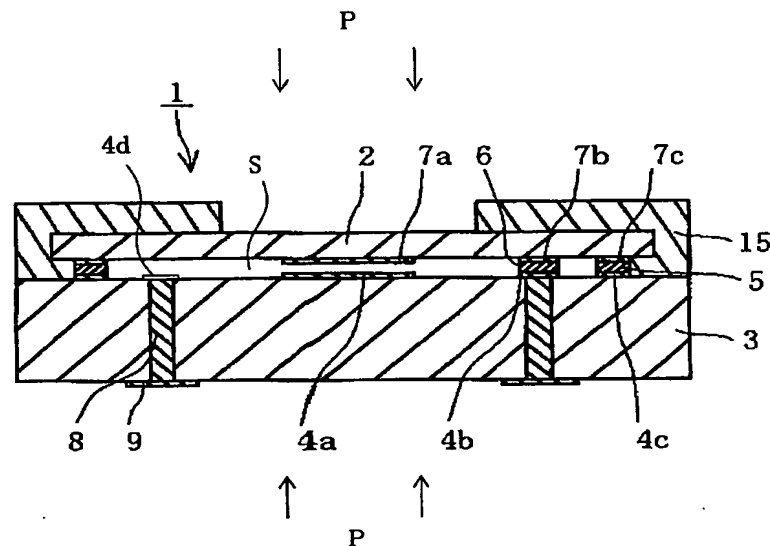
(10) 国際公開番号
WO 2005/052534 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01L 9/00 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 京セラ株式会社 (KYOCERA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6128501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地 Kyoto (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017981
- (22) 国際出願日: 2004 年 11 月 26 日 (26.11.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (72) 発明者; および
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 及川 彰 (OIKAWA, Akira) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町 1 番 1 号 京セラ株式会社鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 松尾 香 (MATSUO, Kaoru) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町 1 番 1 号 京セラ株式会社鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 立岡 博志 (TACHIOKA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町 1 番 1 号 京セラ株式会社鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP).
- (30) 優先権データ:
特願 2003-398183 2003 年 11 月 27 日 (27.11.2003) JP
特願 2003-429373 2003 年 12 月 25 日 (25.12.2003) JP
特願 2003-431596 2003 年 12 月 25 日 (25.12.2003) JP

[続葉有]

(54) Title: PRESSURE SENSOR DEVICE

(54) 発明の名称: 圧力センサ装置



(57) Abstract: A pressure-detecting piezoelectric substrate (2) is mounted on a supporting piezoelectric substrate (3), and a sealing member (5) is provided between the supporting piezoelectric substrate (3) and the pressure-detecting piezoelectric substrate (2). The pressure-detecting piezoelectric substrate (2) has on its upper surface a surface acoustic wave element (4a) for reference. The supporting piezoelectric substrate (3) has a smaller thickness than the pressure-detecting piezoelectric substrate (2) and having on its lower surface a pressure-detecting surface acoustic wave element (7a). The pressure-detecting surface acoustic wave element (7a) and the surface acoustic wave element (4a) for reference can be arranged in a space S surrounded by the supporting piezoelectric substrate (3), the pressure-detecting piezoelectric substrate (2), and the sealing material (5). A small-sized highly reliable pressure sensor (1) capable of performing temperature compensation can be provided.

(57) 要約: 上面に参照用弾性表面波素子 4 a を有した支持用圧電基板 3 上に、支持用圧電基板 3 よりも厚みが薄く、下面に圧力検出用弾性表面波素子 7 a を有した圧力検出用圧電基板 2 を搭載し、支持用圧電基板 3 と圧力検出用圧電基板 1 との間

[続葉有]



WO 2005/052534 A1



(74) 代理人: 稲岡 耕作, 外 (INAOKA, Kosaku et al.); 〒5410054 大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号 サンマリオンNBFタワー21F あい特許事務所内 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

に封止材5を設ける。支持用圧電基板3と、圧力検出用圧電基板1と、封止材5とで囲まれた空間Sに、圧力検出用弾性表面波素子7a及び参照用弾性表面波素子4aを配置することができる。温度補償が可能な、小型高信頼性の圧力センサ装置1を提供することができる。